CLIPPEDIMAGE= JP406267485A

PAT-NO: JP406267485A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 06267485 A TITLE: SCANNING ELECTRON MICROSCOPE

PUBN-DATE: September 22, 1994

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

KOSHIHARA, SHUNSUKE SHINOHARA, MINORU

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

HITACHI LTD

HITACHI INSTR ENG CO LTD

COUNTRY

N/A

N/A

APPL-NO: JP05055421

APPL-DATE: March 16, 1993

INT-CL\_(IPC): H01J037/244; H01J037/252

US-CL-CURRENT: 250/311,378/84

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To detect a proper amount of X-ray by providing a rotatable or

slidable X-ray passage preventive plate having a plurality of X-ray passing

holes which have different hole diameters between a sample and an energy

dispersion type X-ray analyzer.

CONSTITUTION: Incident electrons 2 produced from a filament 1 is applied to a

sample 5, thereby producing characteristic X-rays 6a, 6b, 6c. At that time,

optimal conditions are selected in a CPU 13 from the information of a Faraday's

cup 10 to transmit a signal to a motor 9, which passes through a D/A converter

and an amplifier 15 to rotate the X-ray passage preventive plate 7. Thereby,

the X-ray passing hole of a proper hole diameter is selected from the plural

X-ray passage holes 16a, 16b, 16c, 16d made in the X-ray passage preventive

plate 7. Excessive characteristic X-rays 6b, 6c are not detected by the energy

dispersion type X-ray detector 8 but only the characteristic X-ray 6a is detected. As a result, the simultaneous analysis of the energy dispersion type X-ray analyzer and a wavelength dispersion type X-ray analyzer circuit can be performed.

COPYRIGHT: (C) 1994, JPO& Japio

## (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-267485

(43)公開日 平成6年(1994)9月22日

(51)Int.CL<sup>5</sup>

識別記号 庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H 0 1 J 37/244 37/252

Α

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 3 頁)

(21)出願番号

特顯平5-55421

(22)出顧日

平成5年(1993)3月16日

(71)出顧人 000005108

株式会社日立製作所

東京都千代田区神田駿河台四丁目6番地

(71)出願人 000233240

日立計測エンジニアリング株式会社 茨城県勝田市堀口字長久保832番地2

(72)発明者 腰原 俊介

茨城県勝田市堀口字長久保832番地2 日

立計測エンジニアリング株式会社内

(72)発明者 篠原 実

茨城県勝田市堀口字長久保832番地2 日

立計測エンジニアリング株式会社内

(74)代理人 弁理士 小川 勝男

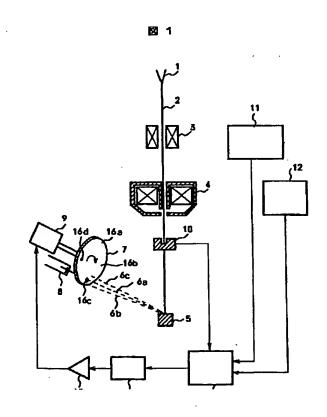
## (54) 【発明の名称 】 走査電子顕微鏡

#### (57)【要約】

【目的】エネルギー分散型X線分析装置と波長分散型X 線分析装置の同時分析を可能とするため、過剰のX線を 防止するX線通過防止板およびX線通過孔を装備した走 査電子顕微鏡を提供すること。

【構成】走査電子顕微鏡において、波長分散型X線分析 装置を用いて分析を行う際、過剰のX線がエネルギー分 散型X線分析装置に侵入することを防ぐため、試料とエ ネルギー分散型X線分析装置との間に穴径の異なる複数 のX線通過孔を持つ回転もしくはスライドする二層構造 のX線通過防止板を設けた

【効果】走査電子顕微鏡を用いたX線分析において、エネルギー分散型X線分析装置と波長分散型X線分析装置の同時分析が可能となる。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】試料室に挿入された試料に電子線を照射し、前記試料より発生する特性X線を検出するエネルギー分散型X線分析装置,波長分散型X線分析装置と前記電子線を発生する走査電子顕微鏡において、前記波長分散型X線分析装置を用いて分析を行う際、過剰のX線が前記エネルギー分散型X線分析装置に侵入することを防ぐため、前記試料とエネルギー分散型X線分析装置との間に穴径の異なる複数のX線通過孔を持つ回転もしくはスライドする二層構造のX線通過防止板を設けたことを 10 特徴とする走査電子顕微鏡。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、試料室内に挿入された 試料に電子線を照射することにより、試料から発生した 特性X線を分析するエネルギー分散型X線分析装置と波 長分散型X線分析装置を装着することが可能な走査電子 顕微鏡に関する。

#### [0002]

【従来の技術】従来の装置では、エネルギー分散型 X線 20 分析装置への過剰な X線の侵入防止については、ほとん ど考慮されていなかった。

#### [0003]

【発明が解決しようとする課題】走査電子顕微鏡には、エネルギー分散型 X 線分析装置と波長分散型 X 線分析装置を同時に装着することが可能であるが、実際の分析において必要とされるプローブ電流は、エネルギー分散型 X 線分析装置では 2×10<sup>-8</sup> A であり、両分析装置の間に大きな差があるため、両分析装置で同時に分析が行えなかっなきがあるため、両分析装置で同時に分析が行えなかっな。本発明では、波長分散型 X 線分析装置の分析条件で電子線を試料に照射した際、発生する特性 X 線においてエネルギー分散型 X 線分析装置にとって過剰の特性 X 線の検出器への侵入を防ぐため、 X 線通過孔を持つ回転もしくはスライドする X 線通過防止板を装備した走査電子顕微鏡を提供することにある。

【0004】また、種々のプローブ電流に対応するため 複数の穴径のX線通過孔を持つX線通過防止板を装備し た走査電子顕微鏡を提供することにある。

【0005】さらにX線通過防止板を軽元素材と重元素 40 材の二層構造とすることにより、反射電子や二次励起X 線の検出器への侵入を防止することが可能となる走査電 子顕微鏡を提供することにある。

### [0006]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、試料とエネルギー分散型 X 線分析装置の間に穴径の異なる複数の X 線通過孔をもつ回転もしくはスライドする二層構造の X 線通過防止板を電子顕微鏡に装着した。【0007】

径の異なる複数のX線通過孔を持つ回転もしくはスライドするX線通過防止板を設ける。この結果、過剰なX線・は、通過できずに適正な量のX線がエネルギー分散型X線分析装置に検出される。

#### [8000]

【実施例】以下、本発明の1実施例を図1に示す。フィ ラメント1より発生した入射電子2がコンデンサレンズ 3,対物レンズ4を通過し、試料5に照射されることに より特性X線6a,6b,6cが発生する。このときフ ァラデーカップ10のプローブ電流値, エネルギー分散 型X線分析装置12のデッドタイムもしくは波長分散型 X線分析装置11の取り込み開始信号などの情報からC PU13で最適条件を選択し、デジタルアナログ変換器 14. 増幅器15を通過した信号をモータ9に送りX線 通過防止板7を回転させる。これにより、X線通過防止 板7にあけられた複数のX線通過孔16a, 16b, 1 6c.16dのうち適正な穴径のX線通過孔が選択さ れ、過剰な特性X線6b,6cがエネルギー分散型X線 検出器8に検出されずに特性X線6aのみが検出され る。この結果、エネルギー分散型X線分析装置と波長分 散型X線分析装置の同時分析が可能となる。

【0009】図2に本発明の第2の実施例を示す。入射電子2が対物レンズ4を通過し、試料5に照射されることにより試料5より発生した特性X線6a,6b,6cのうち過剰な特性X線6b,6cは、軽元素例えばカーボンから成るX線通過防止板7aと重元素例えばタンタルから成るX線通過防止板7bの二層構造のX線通過防止板に吸収され特性X線6aのみがX線検出器8に検出される。また、X線通過防止板7aを軽減素材を使用することにより反射電子の発生を防ぎ、X線通過防止板7bに重元素材を使用することにより二次励起のX線を吸収することが可能となる。この結果、エネルギー分散型X線分析装置,波長分散型X線分析装置の同時分析において、良好な結果が得られる。

【0010】図3に本発明の第3の実施例を示す。X線通過防止板7に複数の異なるX線通過孔16a,16b,16c,16dとブランキングポイント17を設け、回転させる構造とする。この結果、プローブ電流の変化に対応したX線通過孔を選択することが可能となる。さらに、X線検出器に全く信号が入らない状態を選択することも可能となる。

#### [0011]

【発明の効果】本発明によれば、走査電子顕微鏡を用いたX線分析でエネルギー分散型X線分析装置,波長分散型X線分析装置の同時分析が可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】1 実施例に基づく装置構成図である。

【図2】第2の実施例に基づく対物レンズ近傍の装置構成図である。

である。

## 【符号の説明】

1…フィラメント、2…入射電子線、3…コンデンサレンズ、4…対物レンズ、5…試料、6 a, 6 b, 6 c… 特性X線、7…X線通過防止板、8…エネルギー分散型 4

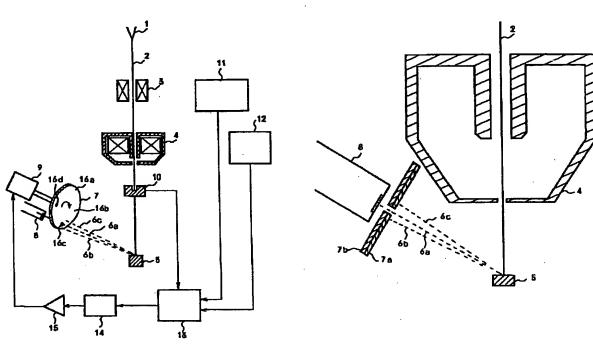
X線検出器、9…モータ、10…ファラデーカップ、1 1…波長分散型X線分析装置、12…エネルギー分散型 X線分析装置、13…CPU、14…デジタルアナログ 変換器、15…増幅器、16a, 16b, 16c, 16 d…X線通過孔、17…ブランキングポイント。

【図1】

図 1

【図2】





【図3】

図 3

